

大気遮断用サンプリングシステム

特許出願中
特願2014-17807

- ・微量ガス分析
- ・サンプル注入時の大気の影響を受けやすいサンプル分析



- ・グローブバッグとセプタムナットを一体化
- ・グローブバッグ内でサンプリングしそのまま注入
- ・ガスクロへサンプル注入時の大気の影響を最小化

Ken ケン商品開発株式会社
〒183-0005 東京都府中市若松町1-5-45
TEL: 042-306-6040 FAX: 042-306-6041
URL <http://www.ken-pd.com>
E-Mail info@ken-pd.com